



高分解能FiDiCa[®]

二次元膜厚分布測定装置により高分解能による局所測定および6インチサイズまでの全面測定を行います。

装置の特徴

● 高分解能による局所測定

6 μ mの高分解能で約3mm角を測定できるため、局所的な測定が求められるデバイスパターン上などの膜厚分布測定に向いています。

● 6インチサイズまでの全面測定

測定点間隔のメッシュサイズを選択でき、6インチウェハサイズまで全面測定できます。

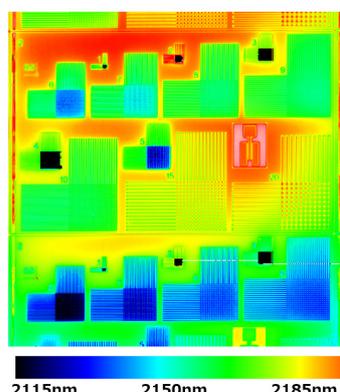
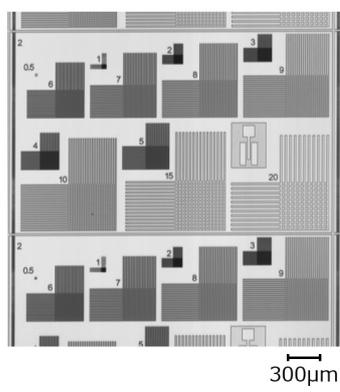
装置仕様

項目	仕様
ハイパースペクトルカメラ分光波長範囲	450-750nm
測定膜厚範囲	100 - 30,000nm (測定対象による)
測定サイズ	局所測定: 2.84mm角 全面測定: 約150mm角
測定点数	局所測定: 484 × 484点 全面測定: 装置設定による
空間分解能	局所測定: 5.86 μ m
測定速度	局所測定: 約30秒 全面測定: 装置設定による
繰り返し再現性	3 σ < 1nm (校正されたSiウェハ上の1 μ m厚SiO ₂ 膜測定時)
光源	白色LED (波長: 450 - 750nm)
装置サイズ	W:510 × D:620 × H:280

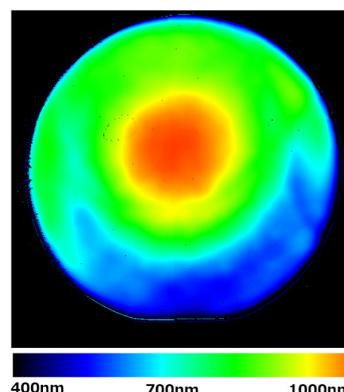
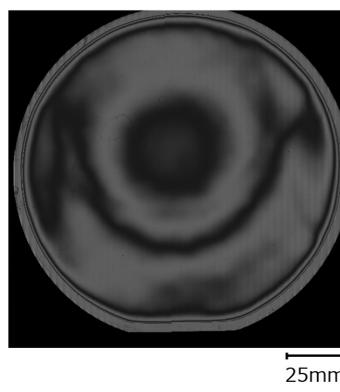


高分解能FiDiCa[®]装置外観

測定例



局所測定例 (シリコン上のTEOS膜)
左: 単一波長画像 右: TEOS膜の膜厚分布



全面測定例 (6インチウェハシリコン上のSiO₂膜)
左: 単一波長画像 右: SiO₂膜の膜厚分布



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2023 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。